# EPMA による均質および非均質 Al-Ag 合金の定量分析

### 丸 野 重 雄

## 材料開発研究施設 (1976年9月2日)

## Quantitative Analysis of Homogeneous and Heterogeneous Al-Ag Alloys with EPMA

## Shigeo MARUNO

## Materials Research Laboratory (Received September 2, 1976)

Quantitative analysis of homogeneous samples consisting of solid solution or intermetallic compound and phase separated heterogeneous samples is performed by using an electron probe microanalyzer with absorption, atomic number and flourescence corrections. The theoretical correction curve is essentially identical with the experimental data based on a chemical analysis for homogenous alloys. The average composition of the heterogeneous alloys within a certatin error in measurement can be determined as well as the composition in the homogeneous system by using parameter "Rd", which was obtained on the basis of a model considered with the texture and the difference of concentration of alloying elements between the phases of sample in the irradiated area of electron beam. The relation between the Rd parameter and the standard deviation of conentration calculated from X-ray intensity in heterogeneous the Al-Ag alloys is consistent with that in heterogenous Al-Cu alloys and is widely applicable to practial quantitative analysis of many binary systems.

#### 1. 緒 言

ミクロン程度の微小領域における元素分析を非破壊的 に行なうことを主目的とするX線マイクロアナライザー (Electron Probe Microanalyzer, 以下 EPMA と略称す る)では、一般に分析対象物から発生する特性X線を利 用する。波長分散型X線分光器を用いた装置では、<sup>4</sup>Be ~<sup>92</sup>Uまでの各元素の分析が可能である。 試料の定量分 析については、これまでに非常に多くの定量補正式が提 案されているが、絶対的方法が決ったわけではない。す なわち、相当信頼度が高いと思われる方法が現在では一 応確立されていると考えてよいが、それらは均質系を前 提として(分析試料を均質と仮定して) 吸収, 原子番号 および螢光励起の各補正を行ない、分析対象元素の真の 濃度を決定しようとするもので,正確には半経験的な理 論式というべきものである(入射電子の試料内での挙動 およびそれに付随した発生関数にまだ不明な点が多いた めである)。

実用試料は、一般に微細な析出物を含むか何らかの形 で相分離しているものが多いので, EPMA による 試料 の分析対象領域をミクロン領域と考えると、非均質試料 とみなすことができる。非均質試料の定量補正について は、均質試料における理論補正式に、入射電子の試料内 での散乱や吸収効果に新しい補正項を導入した補正式が 報告されている<sup>D</sup>。われわれは, 蒸着薄膜を含む多くの Al-Cu 合金を用い,照射電子線径(分析径)を拡大する ことにより、非均質試料の平均組成の決定に、均質系に おける補正式がそのまゝ適用できることを報告した<sup>2)</sup>。 そしてさらに、非均質試料の不均一組織の大きさ(平均 粒子半径,γ,で表示),分離相間の組成差(粒子とマト リックスの間の組成差, Δω, で表示) および分析径の大 きさによって決まる Ra パラメータを考えることによっ て、分析値のばらつきが試料によらず一定となる測定が 可能であることを示した。

ここでは、均質および非均質 Al-Ag 合金を作 製 し, その均質試料の化学分析をもとにして得られた Al およ び Ag 重量濃度の実験値と EPMA 定量補正式による理 論値について比較,検討した。ついで,前記 Al-Cu 合 金の場合と同様に,理論補正式をそのまゝ用いて非均質 試料の平均組成を求める実験を行なった。とくに,分析 径を種々変化させて得られる分析対象元素 (Al お よ び Ag)の濃度の標準偏差 (σ<sub>o</sub>) と Rd パラメータの関係に ついて詳細に調べ,この関係が一般実用二元合金の定量 分析に広く利用できることを明らかにした。

なお、前に述べたように均質系を前提とした EPMA 定量分析の補正式についてはこれまでに多くの報告があ り<sup>3)</sup>、均質系理想合金についての定量補正図表もある<sup>4)</sup>。 しかし、分析対象元素の組合せによっては、広く用いら れている補正式の間にも得られる分析値に数%以上の差 があり、かつ最も信頼度が高いと決められた補正式がな いことを考え、本報告では EPMA 補正式の導入過程と、 本実験に用いた補正式についても述べることにした。

#### 2. 実験方法

試料は、高純度アルミニウム (99.99% 以上) におよ び銀 (99.9% 以上) を用い、フラックス (NaCl 65 wt %, KCl 33 wt%, NaF 2 wt%) 溶融法により作製した。 均質試料としては Al-Ag 合金系の状態図<sup>®</sup> をもとに $\alpha_{AI}$ 固溶体、金属間化合物  $\zeta$  相および  $\beta$  相を、非均質試料と しては組成の異なる 3 種のぎものを作製した。試料の作 製条件は下記の通りである。

定量分析には、波長分散型X線分光器のついた日立 XMA-5型を使用し、加速電圧20kV、試料電流0.02 $\mu$ A、 受光スリット0.5mmで、Al-K $\alpha$ に対して第2 channel ( $\mu$ -ランド半径 R=200mm)、Ag-L $\alpha$ に対して第1 channel (R=125mm) の各 ADP 結晶を用いて同時に 各々のX線強度を測定した。均質試料では、電子線径を 20 $\mu\phi$  一定とし、各試料につき3個所で各3回30秒間計 数した平均値をその試料の測定値とした。非均質試料で は、それぞれの電子線径で試料上のランダムに選んだ10 個所で各3回30秒間計数し、その3回の平均値を測定値 とした。したがって、同一電子線径に対して10個の実測 分析値が得られることになる。

非均質試料は Fig. 2 に示すように相分離しているが, その相の大きさと相間の組成差を, 緒言で述べたように 平均粒子半径(7)と重量濃度差(4ω) で表わすこととした。平均粒子半径については、定量金属組織学的手法により<sup>70</sup>、金属顕微鏡写真上に縦横5本づつ60mmの線を引き、つぎの関係式を用いて求めた。

$$\gamma = 3L\alpha/4nM \tag{1}$$

ここで Lαは目的とする相と交わる線分の全長, nはテ ストライン上にある目的とする相の総数, Mは顕微鏡倍 率である。重量濃度差は,電子線を絞り(≅1µ程度)各 相の元素濃度を求める方法によったが, Al-Ag 合金では 相当広い組成域で単相の形成が可能であるため, 1回の 測定では注目している粒子および粒子相全体の組成の決 定が困難である。したがって,同一試料表面の5個の粒 子について,各粒子内の5個所の点で測定を行ない(25 個所の測定となる),得られた値の平均値を粒子相の組 成とした。

#### 3. 定量補正(理論)

EPMA による定量分析は,入射電子の試料中でのふる まいが極めて複雑でX線の励起過程が簡単に求め難く, 一般に試料とその試料中の分析対象元素の標準試料(通 常純物質を用いることが多い)を用いて行なう。

A元素の標準試料および未知試料中のA元素のX線強 度を  $I_A^A$  および  $I_A^S$  とすると、 $k_A = I_A^S / I_A^A$ とA元素の 重量濃度  $C_A$  との関係はつぎのように表わされる。

 $C_A = Gk_A = G_{Ab} \ G_Z \ G_F \ k_A \tag{3}$ 

ここでGは測定条件が同じならば元素の種類と濃度に のみ依存する補正係数で  $G_{Ab}$ および  $G_Z$ は入射電子によ る直接イオン化 (一次X線),  $G_F$ は間接イオン化 (螢光 X線)に関する補正係数であり,それぞれ吸収,原子番 号および螢光励起補正係数と呼ばれでる。

(i) 吸収補正 (G<sub>Ab</sub>) および原子番号補正 (G<sub>Z</sub>)

X線強度は、試料中の分析対象元素(A元素)の重量 濃度に比例するから

$$I_{A}^{s} = F_{A}^{A}(\chi_{A}^{s}) = \int_{0}^{\infty} \Phi_{A}^{s} (\rho z) exp(-x_{A}^{s}\rho z) d(\rho z)$$
$$I_{A}^{s} = C_{A} F_{A}^{s}(x_{A}^{s}) = \int_{0}^{\infty} \Phi_{A}^{s}(\rho z) exp(-x_{A}^{s}\rho z) d(\rho z)$$

ここで  $\phi$  ( $\rho z$ ) は X線発生量を深さと密度  $\rho$ の積の関数として表わしたもので発生関数と呼ばれ, exp ( $-x_A$ ,  $\rho z$ ) は A元素の特性X線の吸収割合を示すもので,  $x_A = \mu_A \operatorname{cosec} \phi(\mu_A$ は質量吸収係数,  $\phi$ はX線取り出し角度)である。(3)式より。

$$C_{A} = \frac{I_{A}^{S}}{I_{A}^{A}} \cdot \frac{F_{A}^{A}(x_{A}^{A})}{F_{S}^{S}(x_{A}^{S})} = k_{A} \cdot \frac{F_{A}^{A}(x_{A}^{A})}{F_{S}^{S}(x_{A}^{S})}$$
(4)

の関係が得られ、f(x) = F(x) / F(0)とすると、 $C_A$ は

$$C_{A} = k_{A} \cdot \frac{f_{A}^{A}(x_{A}^{A})}{f_{A}^{S}(x_{A}^{S})} \cdot \frac{F_{A}^{A}(0)}{F_{A}^{S}(0)}$$
(5)

となる、f(x) は発生X線強度のうち、どの程度が測定 強度として現われるかを示すものであるから、 $f_A^A(x_A^A) / f_A^a(x_A^a)$  は両試料間の吸収効果の差異を補正する項であ り  $G_{Ab}$ に相当する。また、F(0) は試料において全く吸 収を受けない場合の発生X線強度を示すもので、その値 は構成元素の原子番号に依存する物理量によって支配さ れ、 $F_A^A(0) / F_A^A(0)$  は  $G_Z$ にあたる。

(a)  $G_{Ab} = f_A^A(x_A^A) / f_A^S(x_A^S)$  KOUT:

f(x) について Philibert<sup>8)</sup> はつぎの式を与えている。

$$f(x) = \frac{1+h}{(1+x/\sigma) \{1+h(1+x/\sigma)\}}$$
(6)

ここで  $h=1.2\sum C_i (A_i/Z_i^2)$ ,  $x=\sum C_i \mu^i \csc \phi$ ,  $\sigma$ は レナード定数で Heinrich<sup>99</sup> により  $\sigma=4.5\times10^5/E_o^{1.65}$   $-E_b^{1.65}$  で与えられるもので、A、Z、C、  $\mu$ 、E。および  $E_b$ は、それぞれ原子量、原子番号、重量濃度、質量吸 収係数、加速電圧および臨界励起電 圧(単位 kV)であ る。なお、*i*は未知試料の構成元素を意味し、重量濃度 Cについては $\sum C_i = 1$ である。

(b)  $G_z = F_A^A(0) / F_A^S(0)$  について: F(0) は次式によって与えられる。

$$F(0) = R \int_{E_k}^{E_o} w_k \frac{No}{A} \cdot \frac{Q_k}{S} dE$$
(7)

ここで R,  $E_{s}$ ,  $E_{k}$ ,  $w_{k}$ , No および  $Q_{k}$ は, それぞれ 後方散乱因子,入射電子のエネルギー,イオン化エネル ギー, 蛍光収率, アボガドロ数および励起断面積であ り, S=-dE/d (oz) である。いま $\int_{E_{k}}^{E_{o}}Q_{k}/S dE=P$  (侵 入因子)とすると、

$$G_{\mathbf{z}} = \frac{R_{A}^{A} P_{A}^{A}}{R_{A}^{S} P_{A}^{S}}$$
(8)

である。Bishop<sup>10</sup> と Springer<sup>11</sup> は, 1/P についてつ ぎの式を与えている。

$$\frac{1}{P_A} = \sum C_i \frac{Z_i}{A_i} ln \frac{1.166}{11.5} \frac{E_m^A}{Z_i}$$
(9)

ここで  $E_{A}^{d} = (E_{o} + E_{A}^{d}) / 2$  (単位 V) であり,後方散 乱因子 R は原子番号 (Z) とオーバ・ボルテージレシオ ( $U_{A}^{d} = E_{o}/E_{A}^{d}$ )の関数で  $R = \sum C_{i}R_{i}$ の形で計算される ものであり,実験的に求められた値<sup>12)</sup>を用いることに する。

(ii) 蛍光励起補正 (G<sub>F</sub>)

試料より発生した A元素の総X線強度 (IA) は

$$I_A = {}^{P_r}I_A + {}^{S_\theta}I_A + {}^{f_I}I_A \tag{10}$$

である。ここで  $P_{I_A}$ は一次X線強度,  $S_{I_A}$ は連続X線 に起因する二次X線強度,  $P_{I_A}$ は他元素の特性X線に起 因する二次X線強度である。 $G_F$ は, 本来  $P_{I_A}$ と,  $S_{I_A}$ および  $P_{I_A}$ との割合に関する補正であるから,  $r_S = S_{I_A}$  $P_{I_A}$ ,  $r_f = P_{I_A} P_{I_A} P_{I_A}$ との割合に関する補正であるから、

$$G_F = \frac{(1+\gamma_s + \gamma_f)^A}{(1+\gamma_s + \gamma_f)^s} \tag{1}$$

なお、通常標準試料には分析対象元素の純物質を用いる ので、 $r_{f}^{A}=0$ である。また連続X線による蛍光励起が無 視できるとすると ( $r_{s}=0$ )、 $G_{F}=1/(1+r_{f})$ ・となる。

(a) 連続X線に対する補正 (r.):

Springer<sup>13)</sup> によって与えられた 7.は、分析対象元素 をAとするとつぎのように表わされる。

$$\gamma_{\bullet}(A) = C_{K(L)} A_{A} \overline{Z} E_{K(L)}^{A} \frac{\gamma_{K(L)} - 1}{\gamma_{K(L)}} \cdot \frac{\mu_{K(LA)}^{A}}{\mu_{K(L)A}^{AB}}$$

$$\frac{\ln\left(1+gU_{o}^{A}\right)}{gU_{o}^{A}} \qquad (2)$$

ここで  $C_{\kappa}^{**}=4.34\times10^{-6}$ ,  $C_{L}=3.14\times10^{-6}$ ,  $(r_{\kappa}-1)/$  $r_{\kappa}=0.924-0.00144Z$ ,  $(r_{L}\pi-1)/r_{L}=0.548-0.00231Z$ ,  $\overline{Z}=\sum C_{i}Z_{i}$  (平均原子番号) であり,  $E_{\Lambda}^{*}$ は A原子の K 彀イオン化エネルギー (単位 keV) である。また g= $\{(\mu) \frac{A}{K}/(\mu) \frac{A}{M}\}$  cosec  $\phi$  であり,  $\mu \frac{A}{M}$  は元素 Aの K吸 収端波長 (短波長側) を持つ連続X線が 元素 AB (AB 合金の) によって吸収されるときの質量吸 収 係 数 で,  $\mu \frac{A}{M}$  は元素 Aの Ka 線に対する合金 AB の質量吸収 係 数である。

(b) 特性X線に対する補正 (ア<sub>f</sub>):

Reed<sup>14)</sup> によって与えられた元素 Aに対 する  $r_f$ は, つぎのように表わされる。

<sup>\*</sup> 式(3)の I<sup>A</sup> および I<sup>S</sup><sub>A</sub>は,直接イオン化による一次X線のみを考えた場合のX線強度であり,<sup>Pr</sup>I<sub>A</sub>にあたる。また 上ツキ添字 A および sは標準試料および未知試料を意味する。

$$\gamma_{f}(A) = C_{B}J(A, D - \frac{\mu_{B}^{A}}{\mu_{B}^{AB}} \{g(x) + g(y)\}$$
(13)

ここで $C_B$  はB 元素の濃度,  $D = \{(U_B^{B}-1) / (U_d^{A}-1)\}^{1.67}$ , g(x) = ln(1+x)/x, g(y) = ln(1+y)/yであり, かつ $x = (\mu_A^{AB}/\mu_A^{AB})$  cosec  $\phi$ ,  $y = \sigma/\mu_B^{AB}$  で,  $\sigma$  は レナード 常数で ある。J(A) は、ジャンプ・レシオ ( $r_{A(L)}$ ), 蛍光収率な どを用いて計算することができるが、被励起元素ごとに 被蛍光励起X線および励起X線および励起線を区分して まとめられた数表<sup>40</sup> を用いると便利である。

#### 4. 結果および考察

Al-Ag 系合金の物質試料として、 $\alpha_{Al}$  固溶体 (15.2, 25.1, 35.6 および 44.8 wt % Ag),金属間化合物  $\zeta$  相 (86.8 wt % Ag) および  $\beta$  相 (92.2 wt % Ag) を,非 物質試料として Al-25.7 wt % Ag, Al-45.9 wt % Ag, Al-93.1 wt % Ag の各試料を作製した。

Table 1 は,理想的な均質試料として Al-20 wt % Ag および Al-80 wt % Ag 試料を考え, EPMA によるその 各補正係教 (G<sub>Ab</sub>, G<sub>Z</sub> および G<sub>F</sub>) を 3. の補正式を用

Table. 1 The calculated values of correction terms  $G_{z}, G_{Ab}$  and  $G_{F}$  for compositions Al-20 wt % Ag and Al-80 wt % Ag.

X-ray	G	Al-20wt % Ag	Al-80wt % Ag
Al-Ka	Gz	0.9285	0.8264
	GAD	1.278	2.067
	$G_F$	0.9996	0.9984
Ag-Lα	Gz	1.160	1.015
	GAB	1.127	1.030
	$G_F$	1.005	1.001

いて計算した結果である。なお、Al-Ag 合金では、Al-Cu 合金においてみられるような質量吸収係教( $\mu$ )の値 の研究者による相異はあまりなく<sup>20</sup>、Al-Ka および Ag-La 線に対する Al および Ag の質量吸収係数を、 $\mu_{A}^{Ag}$ = 385.7、 $\mu_{A}^{Ag}$ =3193、<sup>15)</sup> および  $\mu_{Ag}^{Ag}$ =525、 $\mu_{A}^{Ag}$ =813 とし て<sup>16)</sup> 計算を行なった。補正係数のうち  $G_{Ab}$  が最も大き く、その値は銀合有量の多い試料ほど増加する。 $G_Z$ も また相当大きく(補正量として)、 $G_F$ は組成によっては 無視できるほど小さい。このように発光 X 線(特性 X 線)に対して質量吸収係数が大きく異なる合金では、上 記補正のうち軽金属元素の特性 X線に対する吸収補正効 果が最も顕著なものとなる。Fig.1 は、均質試料につい て化学分析値をもとに得られた実験値(O)と理論補正曲 線である。組成が 20wt%>Al>65wt% の範囲では,実 験値と理論値が実験誤差内で一致すると考えてよい。し かし,50wt%<Al<65wt% では,銀の相対強度(標準 試料と未知試料の Ag-L $\alpha$ 線の強度比)が理論値よりも



Fig. 1 Theoretical calculated curves and experimental data obtained for Al-Ag  $\alpha$ -sold soultions and single phase intermetalilc compounds.

小さな値となる傾向がみられた。その理由として, 試料 表面の酸化膜の形成が考えられ, 測定試料は表面研摩後 空気中に長期放置しておくことを避け, できるだけ早く 定量測定を行なうことが大切である。

Fig. 2 は,非均質試料として作製した Al-93.1 wt% Ag 合金の金属顕微鏡写真である。可能な限り電子線径 を絞って,白り部分と黒り部分の組成を求めると,それ ぞれ 91.5% Ag および 94.0% Ag であり,重量濃度差



Fig. 2 Optl icamicrogradh of A1-93.1 lwol a.% Agyt

\*\*  $C_{K(L)}$  および  $\gamma_{K(L)}$  は、測定元素が K—特性X線、L—特性X線の場合の定数、およびそれに対応する K 吸収端および L 吸収端のジャンプレシオ ( $\gamma_K = \mu_{max}/\mu_{min}$ ) である。

(4ω)は 2.5wt%である。また、式(1)により平均粒子半径(r)を求めると r=9.08μである。非均質試料では、 分析径が非常に大きい場合の相対X線強度は、分析場所

(分析個所)によらずほぼ一定であるが、分析径が小さ いと分析場所によって大きくばらつく。このばらつき始 める電子線径(臨界電子線径)は、試料の  $\gamma$  および  $\Delta \omega$ によって変る。分析径を 10~300  $\mu\phi$  の範囲で変化させ 非均質試料の Ag-La および Al-Ka 線の強度を測定し、 標準試料との強度比から対応する Ag と Al の重量濃度 を求めた結果、分析場所の違いになる組成の差はあるが Fig. 1 の補正曲線の関係が、本実験における非均質試料 にもそのまま適用できることがわかった。なお、クラッ ド試料(Al と Ag のはり合せ接合試料)のような極端 な非均質試料では、Fig. 1 の関係が大幅に変るだけでな く、定量分析そのものの意味がないので除外して考える ことにする。

Fig.3 は、非均質試料について分析径を変えて EPMA により求めた Al および Ag の重量濃度を、試料の平均 組成からの重量濃度の差として示したものである。分析 径が小さくなると、前述したように分析場所によって、 Al および Ag の重量濃度の値が相当大きく変動する。 Fig.4 は、同一分析径に対して得られた Al (。印) お よび Ag (•) の重量濃度の標準偏差 ( $\sigma_0$ ) を、各照射 電子線径 (本実験では近似に分析径と同一とみなす) に



Fig. 3 Fluction of the concentration (wt %) of Al and Ag due to the different diameters of electron probe. (Zero in the scales of concentration indicates the average concentration determined by chemical analysis.)



Fig. 4 Standard deviation of the concentrations of Al and Ag in Fig. 3.

対してプロットしたものである。これらの図は、理論補 正曲線を用いて非均質試料の平均組成を求めるには、試 料の非均質性(合金では分離相の大きさおよび相間の組 成差に関係)を考慮した測定を行なう必要のあることを 示している。この目的のために、われわれは次式に示す *Rd*パラメータを報告した<sup>20</sup>。

$$Rd = \frac{R^2}{\gamma^2 \cdot \Delta \omega} \tag{4}$$

ここで R は分析径の半径である。この Rd パラメータ は 1 で述べたように,ある分析径内に組成の異 なる 二 相が存在し,その二相間における分析対象元素の重量濃 度を 1 wt% としたときの,ある一つの相の分析径内 に おける仮想的個数と考えることができる。いま,25.7% Ag および 45.9% Ag 試料の  $\gamma$ および  $\Delta \omega$  を,式(1)お よび Fig.1 の結果を用いて求めると,7 は 9.66 および 7.58  $\mu$ であり, $\Delta \omega$  は 15 および 53 wt %である。

Fig.5は、種々の分析径に対する各非均質試料の Rd の値を求め、Fig.4の  $\sigma_o$ との関係を調べたものである。  $\sigma_o$ -Rdの関係は、 $\gamma$  および  $\Delta \omega$ が異なる試料においても 同一の曲線関係になるとみなすことができる。そしてこ の曲線は、Al-Cu 合金の場合とも一致している。すなわ ち、Fig.5の  $\sigma_o$ -Rd 曲線は、 $\gamma \leftarrow \Delta \omega$ の測定、および分 析径の測定における誤差などにより多少の相異がみられ るが、本質的には似式からも明らかのように合金の種類 や試料によって  $\sigma_o$ -Rd の関係が変るものではない。事 実、Fig.5の  $\sigma_o$ -Rd 曲線は、非均質 Al-Cu 合金におけ るそれと一致している。いま、 $\sigma_o$ -Rd 曲線を  $\sigma_o = (Rd)^n$ + const. の形で表わすと、 $0.2 \leq Rd \leq 0.5$ では  $n \approx -\frac{1}{2}$  $0.5 \leq Rd \leq 2.3$ では n = -1、そして const.=0.3 とな る。



Fig. 5 The relation between the standard deviation of concentration and "Rd" parameter.

非均質試料の定量分析の実測定に先だって、われわれ は  $\sigma_o$ -Rd 曲線の関係を利用して、 $\sigma_o$ がある一定値 と な るような測定を行なうために必要な分析径を、試料の rおよび  $d\omega$  を求めて決定することができる。また逆に、 Rd がある一定な値となるような条件で求められた 分 析 値の  $\sigma_o$ は、各非均質試料についてすべて同一であるとみ なすことがきる。たとえば、非均質試料の組織および組 成の不均一性に起因する測定値のばらつきの $\sigma_o$ が1%を 越えないためには、Rd > 0.6となるように分析径を選ん で測定を行なえばよい(分析径が必要以上に大きいと、 装置の幾何学的誤差が増してよくない)。

上述のように分析径を拡大し、均質系を前提とした補 正を用いて非均質試料の定量補正を行なう方法では、求 められた組成と試料の真の平均組成値(ここでは化学分 析値)とは相当大きな差のあることが予想されたが、実 際には2%以内で一致した(均質試料では1%程度であ った)。一般に、EPMAによる均質試料の定量分析にお いても、用いる補正式や吸収係数の値により数%の誤差 がしばしばみられることを考えると、*a*-*R*<sub>d</sub>曲線を利用 した非均質試料の定量分析法は、実用合金の平均組成を EPMA によって簡便に求めるうえで大いに役立 つ も の と思われる。

#### 5. 結 言

EPMA による定量分析の理論補正式として, 吸収補 正に Philibert (ただし, レナード定教には Heinrich の 関係式を使用), 原子番号補正に Bishop and and Sprin ger, 蛍光励起補正に Reed (特性X線) と Springer (連 続X線) の各式を用いて, 均質 Al-Ag 合金の定量分析 を行ない, 組成 20wt%> Al>60wt% の範囲では, 化 学分析を中心とした実験値と比較的より一致 がみられ た。

非均質 Al-Ag 同金の定量分析は、分析径を拡大して 上記理論補正式をそのまま適用して行なうことができ る。その際、試料の組織および組成の不均一性に起因す る測定値のばらつきは、分析径、平均粒子半径および相 間の組成差によって決きる Rd パラメータを考えること によって定量的に評価することができる。さらに、分析 値の標準偏差 (*a*) と Rd パラメータの関係は、合金の 種類や試料によって変らない一般的性質を有しているこ とが実験的に明らかになった。

本実験法によって得られる非均質試料の定量分析の精 度は均質試料のそれに比較してやゝ劣るが, EPMA に よる実用合金の平均組成としては充分満足すべき結果で あると考えられる。

終りに、本実験の遂行に努力された阪本光君に深く感 謝するものである。

- (1) A. Isogai, Japan. J. Appl. Phys., 9 (1970) 1142.
- (2) 丸野, 伊奈, 金属学会誌, 40 (1976) 140
- (3)内山,渡辺,紀本, X線マイクロアナライザー,日 刊工業(1972) p. 164
- (4) Diarams and Tables for Quantitative Electron Probe Microanalysis (EPMA 定量補正因表), Toyota Central R & D. Labs., Inc. (1970).
- (5) M. Hansen, Constitution of Binary Alloys, Mcgraw -Hill (1958) p. 84.
- (6) 菅原, 道野, 基礎応用定量分析, 朝倉 (1962).
- (7) 佐久間, 西沢, 金属学会会報, 10 (1971) 279.
- (8) J. Philibert, X-Ray Optics and X-Ray Microanalysis, Ed. by H.H. Pattee et al., New York, Academic Press (1962) p. 379.
- (9) K.F.J. Heinrich, 2nd Conf. Electron Microprobe

Analysis (1967), Boston; Anal. Chemist. 44 (1972) 350.

- (0) H.E. Bishop, Brit. J. Appl. Phys., ser. 2, 1 (1968) 685.
- (11) G. Springer, Fortshr. Miner., 45-1 (1967) 103.
- J. Philibert, V th Intern. Cong. X-Ray Opt. and Microanlysis, Ed. by G. Möllenstedt et al., Spring -Verlag Berlin (1967) p. 121.
- (13) G. Springer, Neues Jahrb. Miner. Abh., 106 (1967) 241.
- (14) S.J.B. Reed, Brit. J. Appl. Phys., 16 (1965) 913.
- (15) K.F.J. Heinrich, *The Electron Microprobe*, Ed. by T.D. McKinley et al., John Wiley & Sons (19 66) p. 296.
- (6) G.D. Hughes, J.B. Woodhouse and I.A. Bucklow, Brit.J. Appl. Phys., ser. 2, 1 (1968) 695.